

# ワイドエリア原子間力顕微鏡 (AFM)

**目的** 試料表面の3次元形状計測

**仕様** 日立建機ファインテック(株)製 AFM WA0200  
試料サイズ:最大 20 mm 角(チップ)、φ 50 mm～φ 200 mm(ウェハ)  
最大測定試料高さ:10 mm

	ファインモード	ワイドモード	ステップインモード	プロファイルモード
AFM 測定モード	コンタクト	コンタクト	ステップイン	コンタクト
AFM 検出方式	光てこ方式			
走査範囲(XY)	0.1～10 μm	25 μm～25 mm	0.1～10 μm	10 μm～25 mm (1ライン測定)
高さ制御範囲(Z)	5 μm			
測定点数	最大 512 点 (ワイドモード 25.6、256 μm 時最大 256 点)			最大 250000 点
走査分解能(XY)	0.15 nm	0.1 μm	0.15 nm	0.1 μm
高さ分解能(Z)	0.1 nm (高分解能モード) 1 nm (高精度モード)	1 nm	1 nm (高精度モード)	1 nm

## 利用手順

利用希望者は、事前に装置管理者に電話で申請すること。申請内容は、利用希望日時、所属研究室、氏名。利用後は、備え付けの使用記録簿に所定の事項を記入すること。

## 利用上の注意

所定の講習を受け、装置動作原理を理解し、装置の取り扱いに習熟した者のみに本装置の利用を認める。装置の異常が発生した場合には速やかに装置管理者に連絡すること。試料交換、カンチレバ交換等で装置本体内部に触れる場合には、必ず清浄な手袋を着用のこと。

**設置場所** クリーンルーム2

**装置責任者** 電子情報部門  
尹友 (TEL:1724)

## 連絡先(装置管理者)

電子情報部門 尹友 (TEL:1724)  
email: yinyou@gunma-u.ac.jp

